

# 高輝度高圧電子源開発G 打ち合わせ

- TiNコーティング装置について(本田/武藤)
- 500kV 電子銃 ビーム試験(JAEA)
- 真空テスト装置について
- その他

# 真空テスト装置

- 流路切替え法による測定を前提として進める。
- 必要物品のリストアップ
  - サンプルチェンバー
  - 配管系
  - オリフィス付チェンバー
  - イオンゲージ、ターボポンプ
- TiNコーティングの有用性(条件)について調べる必要あり。

# 電源について

- 電源の容量について前回議論があったが
  - 100 $\mu$ A (7M ERLU) : 極小電流、分圧抵抗に喰われる?
  - 10mA (15M ERLU) : テスト装置として適正
  - 100mA (60M ERLU) : 本機用
- ガス回収装置(8M ERLU)、セラミック(8M ERLU)を含めると厳しい。
- 決定はQ-Beamの結果待ち?

# 表面観察の検討状況について

- STM: テストサンプル(Siチップ)の測定準備中。
- PEEM: 装置の立ち上げを夏に行う。必要な作業について打ち合わせ予定。